

1/4인치 튜브 연결부가 장착된 맞춤형 Ptfе 가스 세정 병, 내부식성 화학 흡수 용기

품목 번호: PL-CP41



소개

극한의 화학 환경에 맞춰 설계된 이 맞춤형 PTFE 가스 세정 병은 공격적인 가스 스크러빙 및 흡수를 위한 비할 데 없는 내부식성을 제공합니다. 안전한 1/4인치 튜브 연결부와 맞춤형 구성을 특징으로 하며, 고순도 연구실 연구와 까다로운 산업용 화학 응용 분야에 적합합니다.

자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
반도체 가스 스크러빙	웨이퍼 제조 중 배기 가스 스트림에서 HF나 실란과 같은 유독 또는 반응성 프로세스 가스를 제거합니다.	장비 부식을 방지하고 고순도 환경에서 환경 규정 준수를 보장합니다.
미량 금속 분석	ICP-MS용 시료를 준비하기 위해 가스를 고순도 산을 통해 통과시켜 휘발성 금속 불순물을 포집합니다.	용기 재료 자체로 인한 배경 노이즈와 오염을 제거합니다.
제약 합성	부식성 촉매가 관련된 활성 약물 성분(API) 생산에서 가스-액체 반응을 제어합니다.	제품 순도를 유지하고 공격적인 유기 용제 환경을 견딥니다.
환경 모니터링	연구실 정량 분석을 위해 산업 배기 가스 시료에서 이산화황이나 질소 산화물을 포집합니다.	용기가 목표 분석 물질과 반응할 위험 없이 정확한 시료 포집을 보장합니다.
석유화학 파일럿 플랜트	가압된 액체 탄화수소에 기체 반응물을 도입하여 새로운 촉매나 첨가제를 테스트합니다.	고압 안전성과 복잡한 탄화수소 혼합물에 대한 화학적 저항성을 제공합니다.
전기화학 셀 배기	대용량 배터리 테스트나 전해 실험 중에 생성되는 부식성 가스를 스크러빙합니다.	민감한 연구실 전자 장치를 산 미스트와 부식성 증기로부터 보호합니다.
산 중화	야금 연구실에서 분해(digestion) 프로세스 중에 생성되는 고농도 산성 증기를 중화합니다.	시간이 지나 예정되고 고장 나는 유리 스크러버에 비해 긴 수명을 제공합니다.
특수 가스 정제	특수 액체 건조제나 스캐빈저를 사용하여 불활성 가스 라인에서 수분이나 미량 산소를 제거합니다.	고무결성 밀봉은 대기의 유입을 방지하여 가스의 건조 상태와 순도를 유지합니다.

매개변수 유형	PL-CP41에 대한 사양 세부 정보
핵심 재료	버진(Virgin) 고순도 PTFE (폴리테트라플루오로에틸렌)
설계 유형	맞춤 제작된 가스 세정 / 흡수 병
표준 포트 구성	1/4인치 (6.35mm) 튜브 연결부가 있는 듀얼 포트 캡
연결 메커니즘	통합 압축 피팅 또는 NPT 나사 포트
용량	완전히 사용자 정의 가능 (일반적으로 50mL ~ 5000mL 범위)
내부 스파저(Sparger)	선택 사항 PTFE 프리트(frit) 또는 천공 딥 튜브 (다공성 사용자 정의 가능)
작동 온도	-200°C ~ +260°C (전 범위에 걸친 일관된 성능)
화학적 저항성	용융 알칼리 금속 및 불소 원소를 제외한 모든 알려진 화학 물질에 저항
밀봉 개스킷	통합 PTFE 대 PTFE 밀봉 또는 선택 사항 FEP 캡슐화 O링

매개변수 유형	PL-CP41에 대한 사양 세부 정보
표면 마감	잔 잔류물을 최소화하고 청소를 용이하게 하는 매끄러운 CNC 가공 마감
제작 방법	100% 정밀 CNC 가공 (물당이나 접착제 사용 안 함)